PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-001904

(43) Date of publication of application: 06.01.1989

(51)Int.CI.

G01B 11/30 G01N 21/88

G11B 7/26

(21)Application number: 62-157044

(71)Applicant: NIPPON COLUMBIA CO LTD

(22)Date of filing:

24.06.1987

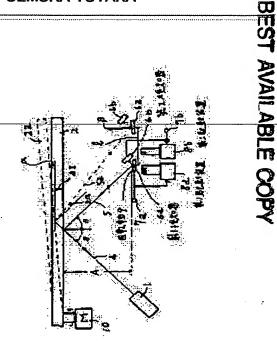
(72)Inventor: UEMURA YUTAKA

(54) APPARATUS FOR MEASURING SHAPE DISTORTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To measure the amount of face deflection of mechanical characteristics of optical disk independently by feeding back the output of first and second irradiation position detectors to the first and second drive units, respectively.

CONSTITUTION: Since the irradiation position of reflected light 5a deviates if the face deflection ΔZ and warpage α are produced, the error outputs 7a and 7b become greater and the first and second drive units 8a and 8b always move in parallel the detectors 6a and 6b to the position of detectors 6a' and 6b' shown by dotted lines and at the same time rotate them for automatic control according to this error output level and polarity. The move distance land rotary angle β corresponding to various kinds of error outputs 7a and 7b using a reference disk ahead of time is measured to calculate the move distance I and rotary angle β for an unknown disk 2 from the error outputs 7a and 7b.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

卯特許出願公開

⑫ 公·開 特 許 公 報(A)

昭64-1904

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和64年(1989)1月6日

G 01 B 11/30 G 01 N 21/88 G 11 B 7/26 D-8304-2F

G-7517-2G

8421-5D 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称

形状歪測定装置

村

到特 顧 昭62-157044

❷出 願 昭62(1987)6月24日

@発明者植

小子川県

神奈川県川崎市川崎区港町5番1号 日本コロムビア株式

会社川崎工場内

の出 願 人 日本コロムビア株式会

東京都港区赤坂4丁目14番14号

社

邳代 理 人 弁理士 山口 和美

明 網 書

1. 発明の名称

形状 査測定装置 2. 特許請求の範囲

光源からのレーザ光を回転する被測定体面に投 射して、その反射光の照射位置の変化量を検しして、その反射光の照射位置の変化量を検しして被測定する装置にかいるの角度を持つて向かい合う様に互いに固定域に た第一及び第二の照射位置検出器と、上記両機と、上記両機を 器を回動させる第1級数を置と、上記両機び 器を回動させる第2級数装置と、上記所 での照射位置検出器の出力をそれぞれ上記部 で第2級数接置にフィードパックして、上記射 が第2級数接置にフィードパックして、上別射 が第2級数接置にフィードパックして、上別射 が第2級数接置にフィードパックして、上別射 が第2級数接置にフィードパックして、上別射 が出場の所定位置にする制御手段とを有する形状 を測定模置。

3. 発明の詳細を説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光デイスク記録媒体等の形状の機械 的変形特性を光学的に検出する例定装置に関する。 (従来の技術)

従来の光学式記録媒体等の変形特性を測定する 面提れ測定装置を第3図に示す。これは光原1か ら出たレーザ光4をレンズで、モータ10により 回転するデイスク2の面上に収束させ、デイスク 2からの反射光5を検出器3に収束し、デイスク 2及び、面振れにより平行移動したデイスク2'に 対応する収束点の変化」を測定し、面振れ量を検 知するものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしたがらとの方式はデイスク2の上下扱れ に伴うデイスク面の領きが反射光束の変位に影響 を与える点と、その影響因子であるデイスク面の を与える点と、その影響因子であるデイスク面の を与れる点と、その影響因子であるデイスク面の は同は19項128月上間は19項128日間は19項128日間に19項128日間に19項128日間に19項128日間に19項128日間に19項128日間に199128日に199128日間に199128日間に199128日間に199128日間に199128日間に199128日に199128日間に199128日に199128日間に199128日に199128年に199128年に199128日に199128年に199128年に199128年に199128年に199128年

(実施例)

以下図面を参照して本発明の実施例について述べる。第1図は本発明による一実施例の充学系を示すものである。図にかいて、第3図と同一の部分には同一符号を付してその説明を省略するも、 実験で示すディスク2に対して点線で示すディス

特開昭64-1904(2)

クB 杉対しで広線で示すデキスク2 a はディスク 2が面振れ及び反りの両方を生じた状態を示す。 又、位置検知器として複数の受光索子からなる第 1 及び第 2 検知器 6 a 及び 6 b を有し、 器 6 a の受光面はデイスク2K平行で、位置調差 出力? aは第1駆動装置8 aに加えられ、該第1 緊動裝置 8 a 化上記誤差出力 7 a 化応じて第 1 。 第2検知器6a,6bを1体にデイスク2に対し てその半径方向に平行移動させる。又、第1検出 器 6 a K向かい合つて固定された第 2 検知器 6 b の位置誤差出力7 b は、第2駆動装置8 b に加え られ、該第2駆動装置8 b は、上記誤差出力7 b た応じて、第1,第2検知器6a. 6 b を、 検知器6 a に設けた反射光5 に垂を回転軸9の回 りに回動させる。以上の構成において、レーザ光 孫 1 を出射したレーザ光 4 は、ディスク 2 にょつ て反射され、第1検知器6aに入射し、さらに第 2 検知器 6 b に入射する。とれら検知器 6 a 及び 6.b は第2図に示される滋り受光面が向かい合つ ており、お互いの受光面の成す角は、検出磁度を

まで平行移動させると共に回転させて自動制御する。こうした制御による移動距離 A 及び 7 b に比例 はそれぞれ上記誤差出力 7 a 及び 7 b に比例 している。従つてあらかじめ基準となるディスクを用いて各種の誤差出力 7 a 及び 7 b に対応、未知のディスク 2 に対する移動距離 A 及び回転角 A を、上記誤差出力 7 a 及び 7 b から算出出来る。

ここで、上記反射光 5 と 5 4 とのなす角は 2 α であるから、第 2 の検知器 6 b への照射位置が中央になる様に制御された状態では、上記回転角 β は上記反り角 α の 2 倍となるので、

$$\alpha \Rightarrow \frac{\beta}{2}$$

からαを算出することが出来る。

次に移動距離 1 は面接れ 4 2 と反り角 α 0 2 因子によつて定まり、移動距離 1 と先に求めた反り角 α とから数値計算にて面扱れ近 4 2 を求める事が出来る。即ち

最大にする為、レーザ光4がデイスク2に入射す る入射角ℓと同じになつている。との位置関係に より、検知器6 aの受光面に入射する反射光5の 入射角もりであり、これがさらに検知器6aを反 射して検知器 6 b の受光面の中央に垂直に入射す る様になつている。今、第1図のデイスク2で示 す通り面振れも反りも生じていないディスク2を 回転させた場合、光4はディスク2の中央に角度 P で入射し、角度 P で出射した後、検知器 6 a の 中央に当り、再び反射して検知器66に垂直に入 射する。この様に検知器6a,6bの中央に入射 する場合位置誤差出力7a及び7bはゼロであり、 上記検知器6a及び6bは何ら駆動されない。次 に点根で示すディスク2aの如く面揺れる乙と反 りαが生じた場合、反射光 5 αの照射位置はずれる ので、誤差出力7a,7bは大となり、この誤差 出力のレベル及び極性に応じて、第1及び第2駆 動装置8a及び8bは、上配照射位置が常に検知 器6a,6bの中央に来る様に、これら彼知器6 a,6bを、点線で示す検知器6a/,6b/の位置

$$AZ = \frac{l - A \{ \tan (\theta + 2\alpha) - \tan \theta \}}{\tan (\theta + 2\alpha) + \tan \theta}$$

なか、本発明にかいては第1及び第2の検知器6 a及び6bのなす角は、必ずしもレーザ光4のデ イスク2に対する入射角 d と等しくする必要はないが、上述の如くこれらを等しくすることによつ て、第2の検知器6bに対する入射光を、その受 光面に対して垂直にすることが出来、検出感度を 向上させることが出来る。

(効果)

以上の様に本発明によれば極めて簡単な構成により光ディスクの機械的特性の内の面振れ量と反り角なを独立に翻定出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実品例を示す概略図、第2 図はその要部拡大図、第3図は従来例を示す概略 図である。

6a,6b … 検知器

8a,8b … 堅動装置

